

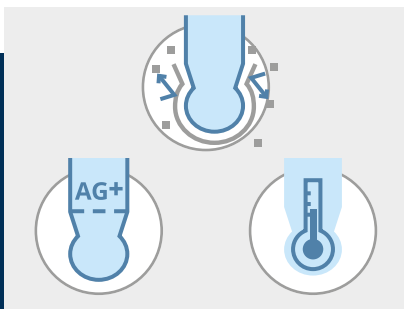
SE571

화학 산업 및 도장 설비 분야의 까다로운 공정에 사용하기 위한 유지·보수 필요성이 적은 pH 센서



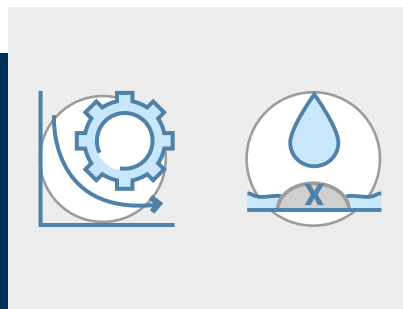
염수 및 강산성 또는 강알칼리성 산화성 매질과 같은 극한 이온 농도 조건에서의 측정

특수 설계로 인해 고압 조건에서도 까다롭고 오염된 매질에서의 pH 측정이 가능합니다. 막힘 위험이 최소화된 PTFE 링 개방구를 통해 기준 전극 시스템이 측정 매질과 접촉합니다. 은 이온 누출 방지 장치가 있는 특수 배출 카트리지가 기준 전극 시스템의 오염을 방지하고, 전해질 저장고가 침출을 방지합니다. 이 센서는 Knick의 Memosens II의 진화된 기술로 높은 주변 온도용으로 설계되었습니다.



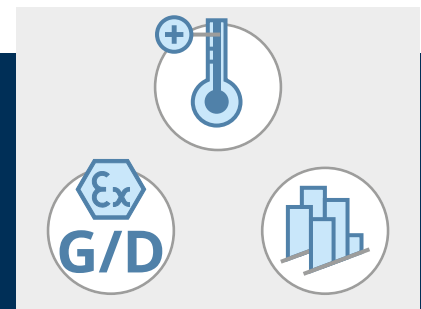
신뢰할 수 있는 측정 기술

- PTFE 링 개방구, 막힘 없음
- 은 이온 누출 방지 및 전해질 저장고
- 내장된 온도 감지기



설계 및 소재

- 유지·보수 필요성이 적고 전해질 보충이 필요하지 않음
- 사용 가능한 사양: 도료 습윤 방해 물질 불포함(無 PWIS)



Knick의 Memosens II

- 주변 온도 최대 100 °C
- 기체 및 분진 방폭 승인
- 부하 매트릭스를 이용한 진단 및 그래픽 디스플레이가 있는 측정 기기의 통제

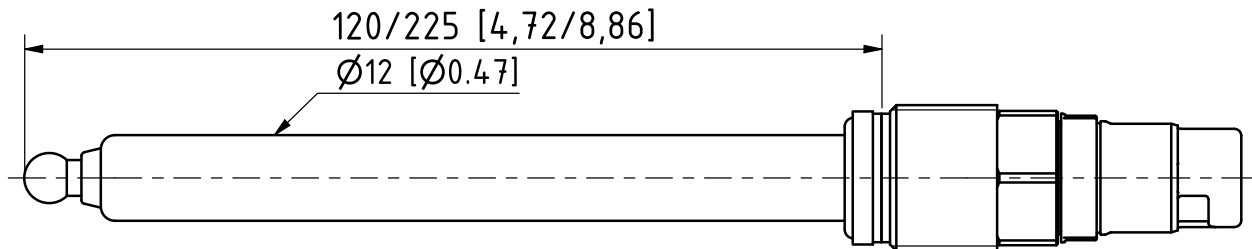
제품 사양(발체본)

사용 설명서에서 발체. 자세한 정보는 → knick-international.com 참조

측정 범위	
pH	0~14
공정 온도	-5~130 °C(23~266 °F)
공정 압력	0~12 bar(0~174 psi)
온도 감지기	NTC 30 kΩ
매질 접촉부의 재질	
몸체	유리
개방구	PTFE 링
전해질	KCl 저장고 링이 있는 젤
센서 끝부분	알파 유리
기준 전극 시스템	은 이온 누출 방지 장치가 있는 Ag/AgCl
공정 연결	PG 13.5
조임 토크	1~3 Nm
전기 연결부	Memosens 센서 연결부
치수	치수 도면 참조

치수 도면

참고: 모든 치수는 mm [inch] 단위로 제공됩니다.



Knick
Elektronische Messgeräte
GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22, 14163 Berlin

독일

전화: +49 30 80191-0

팩스: +49 30 80191-200

info@knick.de • www.knick-international.com

사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.